

微区薄膜测量仪及 反射光度计

微区薄膜测量仪及反射光度计：

用于微米级表面尺寸光学反射率、薄膜厚度及膜层材料光学参数（n&k）的快速测量。可以在 0.1 秒钟内同时获取单层薄膜的厚度和材料光学参数。该仪器可用于各种环境，如实验室、工厂生产线及野外的实时测量。

关键优势：

- 小光斑：测量光斑直径从 5 μm 到 100 μm
- 测速快：单点测量时间小于 0.1 秒
- 精度高：反射率精度 0.3 %，膜厚精度达 0.2 nm
- 波长范围：350 nm 至 1000 nm，1000 nm 至 1700 nm
- 小型便携：重量 2.8 公斤，USB 连接计算机，软件易学好用

应用领域：

- 光学镀膜：镜片增透膜、高反膜、分光膜测量
- 医疗器件：内窥镜镜片反射率、内聚对二甲苯保护层、医疗器械表面涂层测量
- 半导体制造：二氧化硅（ SiO_2 ）、氮化硅（ Si_3N_4 ）、ITO（氧化铟锡）、有机发光层、聚酰亚胺（PI）、光刻胶厚度测量
- 太阳能电池：氮化硅减反射膜、氧化铝钝化层测量



参数	技术指标
测量内容	反射率，膜层厚度及光学常数（n&k）
光斑尺寸	5 μm ，10 μm ，50 μm ，80 μm ，100 μm
膜厚范围	15 nm 至 100 μm ，精度为 0.2 nm
测量时间	单点测量时间小于 0.1 秒
光谱范围	350 nm 至 1000 nm，1000 nm 至 1700 nm
样品尺寸	1 mm 至 100 mm
仪器重量	2.8公斤
仪器尺寸	29 x 23 x 25 cm
数据处理	USB 数据传输，配套软件 Film_Analyzer
操作系统	Windows 10及以上系统
电源	100~240 VAC，50/60 Hz，0.4 A